

★★★ <第31回知的財産翻訳検定試験【第4回独文和訳】> ★★★

《ドイツ語課題》

【解答にあたっての注意】

1. 問題の指示により和訳してください。
2. 解答語数に特に制限はありません。適切な箇所で行って改行してください。
3. 課題文に段落番号がある場合、これを訳文に記載してください。
4. 課題は3題あります。それぞれの課題の指示に従い、3題すべて解答してください。

問1. 下記の独文は、ある独国実用新案明細書の記載からその一部を抜粋したものです。全文を日本語に翻訳してください。

Durch die Verwendung von Plastiktüten kommt es zu einer großen Umweltverschmutzung, da diese in der Regel dem Hausmüll oder dem Gelben Sack\* zugeführt werden. Kunststofftüten sind nicht biologisch abbaubar und aufgrund ihrer geringen Qualität in der Regel nur einmal nutzbar, und werden danach entsorgt.

Auch wird das sogenannte landschaftliche Littering in städtischen oder ländlichen Gebieten durch dünne Plastiktüten, die leicht durch die Luft geweht werden können, verstärkt. Ein Sammeln derartiger Plastiktüten und deren Säuberung verursacht hohe Kosten, so dass dies nicht im Interesse der Industrie ist. Durch die in der Umwelt achtlos weggeworfenen Tüten können große Gefahren für Tiere oder Pflanzen entstehen, wobei Plastikmüll im Meer ein immer größer werdendes ökologisches Problem darstellt, das als marines Littering bezeichnet wird.

※ ドイツで使用されている「資源ゴミ用の黄色いゴミ袋」

Ausgehend von den Problemen des oben genannten Standes der Technik ergibt sich die Aufgabe, einen wiederverwendbaren Verpackungsbeutel vorzuschlagen, der zum einen eine hohe Qualität und damit mehrfache Wiederverwendbarkeit aufweist, zum anderen luftdurchlässig und transparent ist.

問 2. 下記の独文は、ある PCT 国際公開明細書における記載からその一部を抜粋したものです。全文を日本語に翻訳してください。なお、図 1 および図 2 は、線材直径 (Leitungsdurchmesser) を測定するための実施形態を示す側面図です。

Fig. 1 zeigt eine Richtvorrichtung 15 zum Begradigen einer elektrischen oder optischen Leitung 11 mit einem Richtwerk 20, mit einer Steuerungseinrichtung 50 und mit einer Überwachungseinrichtung 100. Das Richtwerk 20 umfasst eine Basis 22, an der eine erste Rollenreihe 21, mit mehreren drehbar gelagerten Rollen 24, angeordnet ist und eine zweite Rollenreihe 31, mit mehreren drehbar gelagerten Rollen 34, angeordnet ist. Die erste Rollenreihe 21 ist auf einem ersten Träger 23 angeordnet und die zweite Rollenreihe 31 ist auf einem zweiten Träger 33 angeordnet. Der erste Träger 23 weist Vorsprünge 26 auf und der zweite Träger 33 weist Aussparungen 36 auf, welche zumindest teilweise ineinandergreifen. Das Richtwerk 20 umfasst einen Zustellantrieb 27.

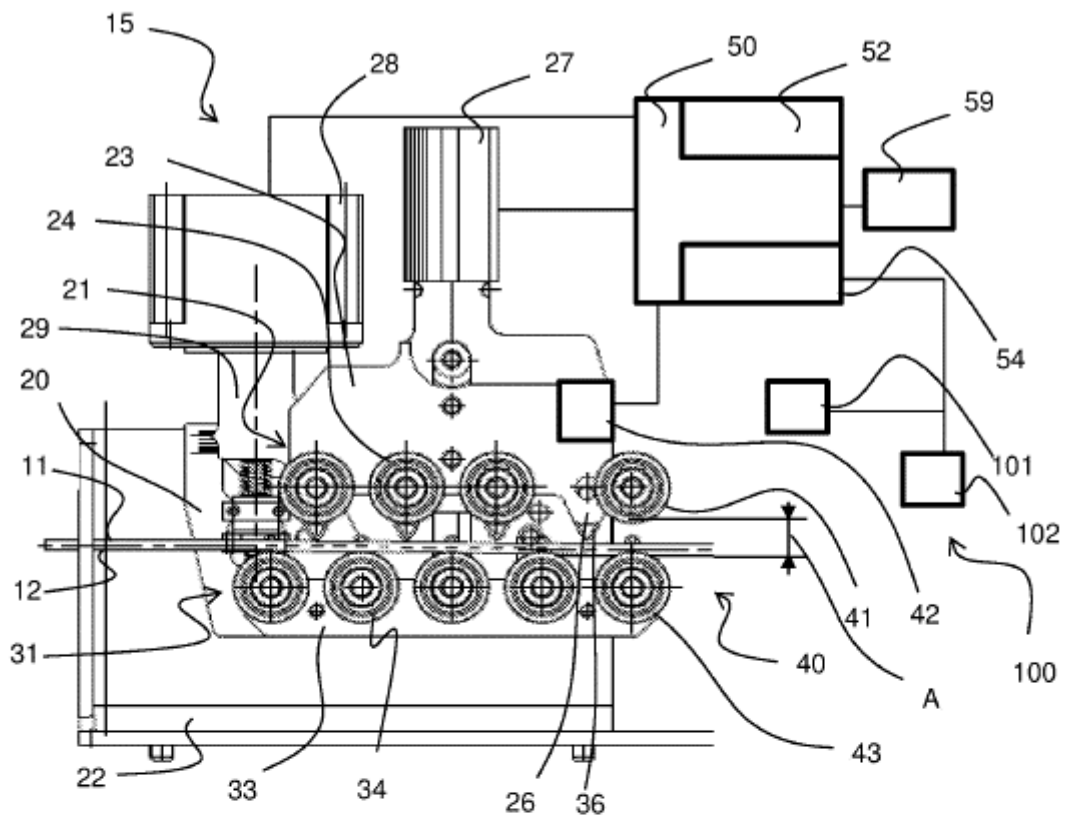
Der Zustellantrieb 27 stellt die erste Rollenreihe 21 zur zweiten Rollenreihe 31 zu, sodass sich der Abstand zwischen der ersten Rollenreihe 21 und der zweiten Rollenreihe 31 verringern wird, bis die Rollen 24 der ersten Rollenreihe 21 die Leitung 11 berühren und die Leitung 11 halten.

Die Richtvorrichtung 15 umfasst eine Messeinrichtung 40 zum Bestimmen des Leitungsdurchmessers der Leitung 11, welche am Richtwerk 20 angeordnet ist. Die Messeinrichtung 40 umfasst eine drehbar gelagerte Messrolle 41, welche beweglich am ersten Träger 23 angeordnet ist und einen Messrollenantrieb 42. Die Messeinrichtung 40 umfasst zusätzlich eine drehbar gelagerte Anpressrolle 43, welche fest am zweiten Träger 33 angeordnet ist.

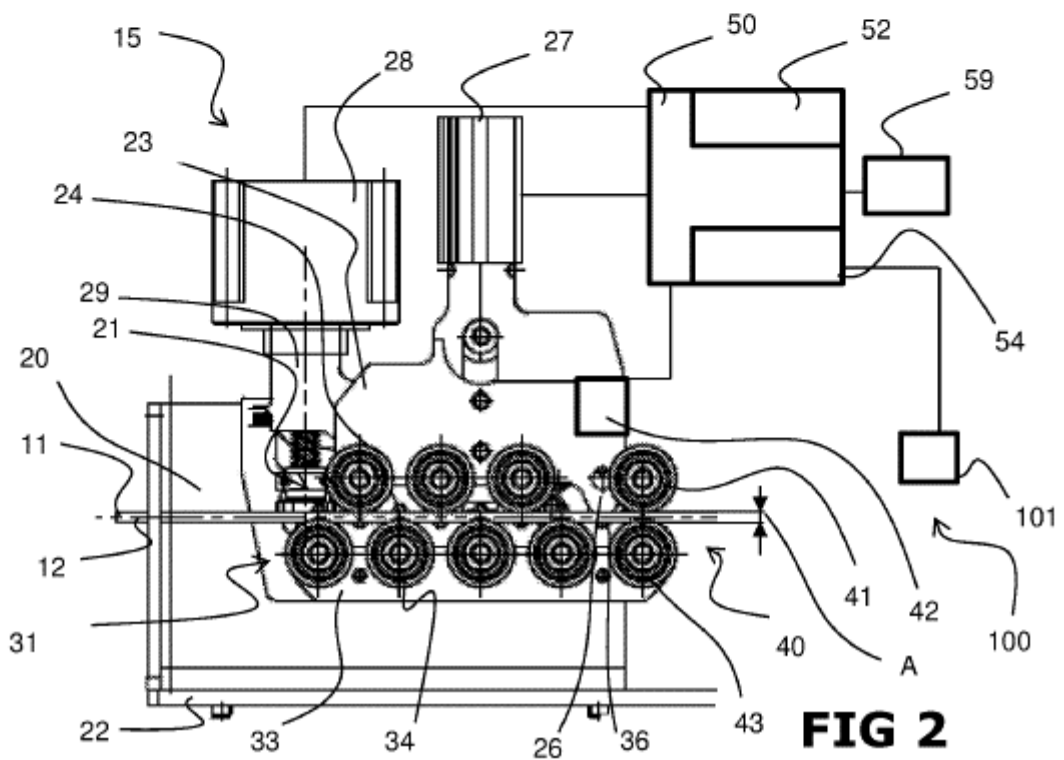
Fig. 2 zeigt die zuvor beschriebene Richtvorrichtung 15, wobei die erste Rollenreihe 21 bereits zur zweiten Rollenreihe 31 zugestellt ist, wodurch sich das Richtwerk 20 bereits in einem geschlossenen Zustand befindet.

Am Messrollenantrieb 42 ist ein Wegsensor angeordnet, welcher den zurückgelegten Weg der Messrolle 41 vom geöffneten Zustand gemäss Fig. 1 zum hier gezeigten geschlossenen Zustand ermittelt. Dieser zurückgelegte Weg der Messrolle 41 wird als Messdaten an die Steuerungseinrichtung 50 übermittelt.

Die Steuerungseinrichtung 50 übermittelt die empfangenen Messdaten an die Recheneinheit 52. Die Recheneinheit 52 bestimmt anhand der übermittelten Messdaten den Leitungsdurchmesser der Leitung 11 bzw. den Abstand  $A$  zwischen der Messrolle 41 und der Anpressrolle 43, welcher dem Leitungsdurchmesser der Leitung 11 entspricht, und berechnet aus dem bestimmten Leitungsdurchmesser einen Sollwert zum Zustellen der ersten Rollenreihe 21 zur zweiten Rollenreihe 31.



**FIG 1**



**FIG 2**

問3. 下記の独文は、ある独国特許出願公開明細書における特許請求の範囲の記載からその一部（請求項1、4、5）を抜粋したものです。ドイツ語見出し語も含め、図面を参考にして全文を日本語に翻訳してください。

なお、図面中、符号3は「Keimschicht」（insbesondere Leiterbahnen）を表し、符号7は「Vorderseite des Halbleiter-Substrats (2)」を表し、符号8は「Rückseite des Halbleiter-Substrats (2)」を表し、符号9は「Kontakt-Struktur」を表し、符号10は「dielektrische Passivierungsschicht」を表します。

### Patentansprüche

1. Halbleiter-Element (1) mit

- a. einem Halbleiter-Substrat (2),
- b. mindestens einer darauf angeordneten, elektrisch leitenden ersten Schicht (5) und
- c. einer auf der ersten Schicht (5) angeordneten lötbaren Korrosions-Schutzschicht (6),
- d. wobei die Korrosions-Schutzschicht (6) zumindest einen Anteil Nickel aufweist.

4. Halbleiter-Element (1) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der ersten Schicht (5) und dem Halbleiter-Substrat (2) eine Diffusionsbarriere (4) angeordnet ist.

5. Halbleiter-Element (1) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Diffusionsbarriere (4) die gleiche chemische Zusammensetzung aufweist wie die Korrosions-Schutzschicht (6).

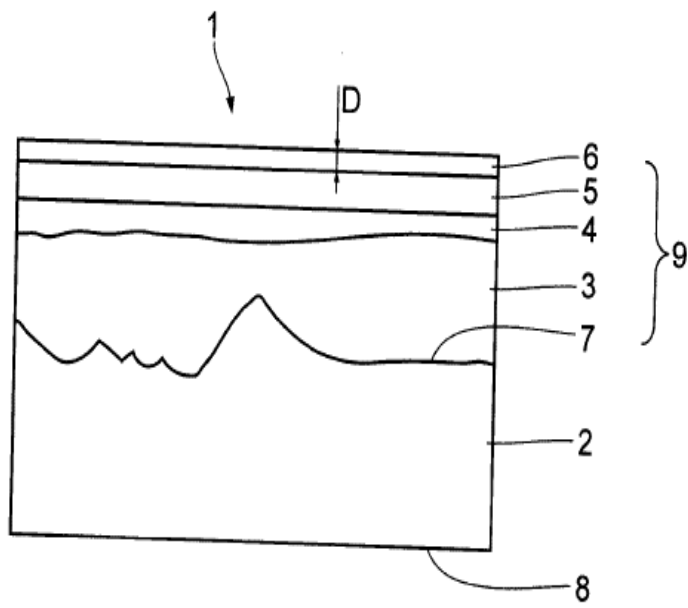


Fig. 1

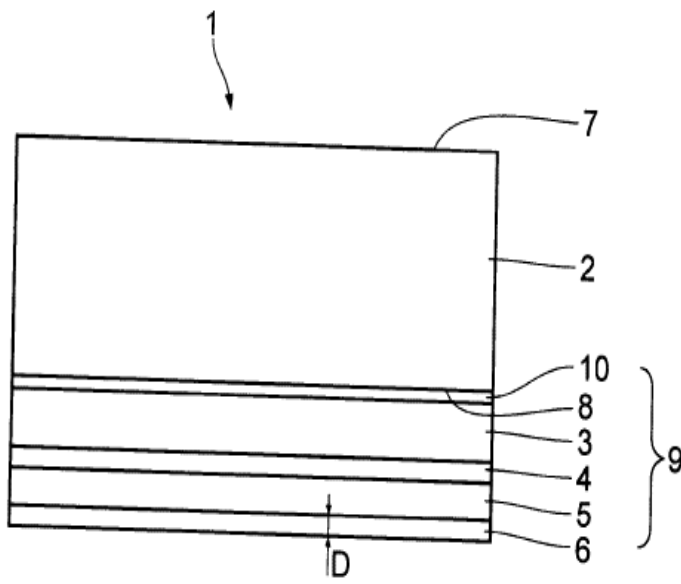


Fig. 2